

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-098205
 (43)Date of publication of application : 03.04.2003

(51)Int.Cl. G01R 29/08
 G01J 4/04
 G01R 15/24
 G01R 29/12

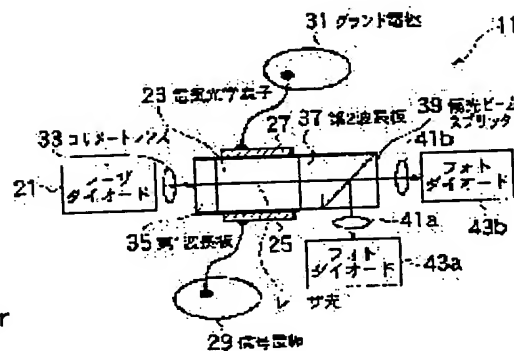
(21)Application number : 2001-295139 (71)Applicant : NIPPON TELEGR & TELEPH CORP
 <NTT>
 (22)Date of filing : 26.09.2001 (72)Inventor : SHINAGAWA MITSURU
 KURAKI OKU

(54) FIELD DETECTING OPTICAL DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a field detecting optical device used in a transceiver for a wearable computer without a wire, not radio-transmitting and basically independent of earth ground, and used for precisely performing data communication by an electric field.

SOLUTION: The field induced and transmitted to a field transfer medium is connected to an electro-optic element 23 through a first electrode 25 to change the optical characteristic of the electro-optic element 23, whereby the polarization state of a laser beam entering the electro-optic element 23 changed in optical characteristic from a laser diode 21 is changed, the laser beam emitted from the electro-optic element is separated into P-wave and S-wave by a polarization beam splitter 39 to be converted to the intensity change of light, and the P-wave and S-wave are converted to electric signals by a first and second photodiodes 43a, 43b and outputted.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 22.01.2003
 [Date of sending the examiner's decision of rejection]
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
 [Date of final disposal for application]
 [Patent number]
 [Date of registration]
 [Number of appeal against examiner's decision]

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2003-98205
(P2003-98205A)

(43) 公開日 平成15年4月3日 (2003.4.3)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G 0 1 R 29/08		G 0 1 R 29/08	F 2 G 0 2 5
G 0 1 J 4/04		G 0 1 J 4/04	Z
G 0 1 R 15/24		G 0 1 R 29/12	F
29/12		15/07	C

審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2001-295139(P2001-295139)

(22) 出願日 平成13年9月26日 (2001.9.26)

(71) 出願人 000004226

日本電信電話株式会社
東京都千代田区大手町二丁目3番1号

(72) 発明者 品川 満

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日
本電信電話株式会社内

(72) 発明者 久良木 健

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日
本電信電話株式会社内

(74) 代理人 100083806

弁理士 三好 秀和 (外1名)

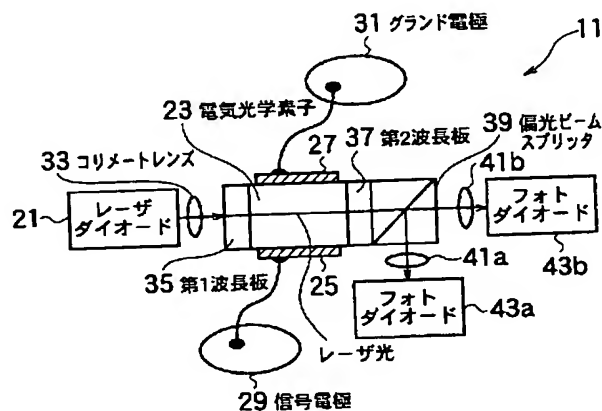
Fターム(参考) 2G025 AA00 AB10 AC06

(54) 【発明の名称】 電界検出光学装置

(57) 【要約】

【課題】 電線を必要とせず、無線でもなく、また大地グランドにも基本的には依存せずにウェアラブルコンピュータ用のトランシーバに使用され、電界を用いてデータ通信を適確に行うために使用される電界検出光学装置を提供する。

【解決手段】 電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を第1の電極25を介して電気光学素子23に結合させて電気光学素子23の光学特性を変化させることにより、この光学特性の変化した電気光学素子23に対してレーザダイオード21から入射したレーザ光の偏光状態を変化させ、この電気光学素子から出射したレーザ光を偏光ビームスプリッタ39でP波とS波に分離して光の強度変化に変換し、P波およびS波を第1、第2のフォトダイオード43a、43bで電気信号に変換して出力する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を検出して電気信号に変換する電界検出光学装置であって、

単一波長の光を発生する光源と、

この光源からの光を平行光にするコリメートレンズと、
該コリメートレンズからの前記平行光を入射され、かつ結合される電界に感応して光学特性が変化する電気光学素子と、

前記電界伝達媒体に誘起された電界を前記電気光学素子 10
に結合させるための第 1 の電極と、
前記電気光学素子を通過した前記平行光を P 波と S 波に分離し、かつ光の強度変化に変換する検光子と、
該検光子で分離された P 波および S 波のうち少なくとも一方を電気信号に変換する第 1 の光電気変換手段とを有し、

前記第 1 の電極は、前記電気光学素子内を進行する前記平行光を挟むように位置する前記電気光学素子の対向する側面の一方に配置されることを特徴とする電界検出光学装置。

【請求項 2】 電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を検出して電気信号に変換する電界検出光学装置であって、

単一波長の光を発生する光源と、

この光源からの光を平行光にするコリメートレンズと、
該コリメートレンズからの前記平行光を入射され、多重反射させて出射すると共に、結合される電界に感応して光学特性が変化する電気光学素子と、

前記電界伝達媒体に誘起された電界を前記電気光学素子
に結合させるための第 1 の電極と、
前記電気光学素子より出射した前記平行光を P 波と S 波に分離し、かつ光の強度変化に変換する検光子と、
該検光子で分離された P 波および S 波のうち少なくとも一方を電気信号に変換する第 1 の光電気変換手段とを有し、

前記第 1 の電極は、前記電気光学素子内で多重反射している前記平行光を挟むように位置する前記電気光学素子の対向する側面の一方に配置されることを特徴とする電界検出光学装置。

【請求項 3】 前記コリメートレンズと前記電気光学素子との間に設けられ、コリメートレンズからの平行光の偏光状態を調整して電気光学素子に入射する第 1 の波長板、

前記電気光学素子の前記対向する側面の他方に設けられ、前記第 1 の電極に対してグランド電極として機能する第 2 の電極、

前記電気光学素子と前記検光子との間に設けられ、電気光学素子を通過した平行光の偏光状態を調整して検光子に入射する第 2 の波長板、および前記検光子で分離された P 波および S 波のうちの他方を電気信号に変換する第 50

2 の光電気変換素子のうち少なくとも 1 つ以上を更に有することを特徴とする請求項 1 または 2 記載の電界検出光学装置。

【請求項 4】 前記平行光の入射方向において対向する電気光学素子の両側面に設けられ、平行光を電気光学素子内で多重反射させるための第 1 および第 2 の反射膜を更に有することを特徴とする請求項 2 記載の電界検出光学装置。

【請求項 5】 電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を検出して電気信号に変換する電界検出光学装置であって、

単一波長の光を発生する光源と、

この光源からの光を平行光にするコリメートレンズと、
該コリメートレンズから前記平行光を入射され、かつ結合される電界に感応して光学特性が変化する電気光学素子と、

該電気光学素子の前記平行光の入射する端面に対向する他方の端面に設けられ、前記平行光を反射する反射膜と、

20 前記電界伝達媒体に誘起された電界を前記電気光学素子に結合させるための第 1 の電極と、

前記コリメートレンズと電気光学素子との間に設けられ、コリメートレンズからの平行光を通過させて電気光学素子に入射させ、前記反射膜で反射され、電気光学素子から入射方向に出射する前記平行光を P 波と S 波に分離し、光の強度変化に変換するアイソレータと、
該アイソレータで分離された P 波および S 波のうち少なくとも一方を電気信号に変換する第 1 の光電気変換手段とを有し、

30 前記第 1 の電極は、前記電気光学素子内を進行する前記平行光を挟むように位置する前記電気光学素子の対向する側面の一方に配置されることを特徴とする電界検出光学装置。

【請求項 6】 前記電気光学素子の前記対向する側面の他方に設けられ、前記第 1 の電極に対してグランド電極として機能する第 2 の電極、

前記アイソレータで分離された P 波および S 波のうちの他方を電気信号に変換する第 2 の光電気変換素子、および、

40 前記アイソレータと電気光学素子との間に設けられ、平行光の偏光状態を調整する波長板のうち少なくとも 1 つ以上を更に有することを特徴とする請求項 5 記載の電界検出光学装置。

【請求項 7】 前記アイソレータは、

前記コリメートレンズからの平行光を通過させるとともに、電気光学素子からの反射光から P 波または S 波を分離して光の強度変化に変換する第 1 の検光子と、

該第 1 の検光子を通過したコリメートレンズからの平行光および電気光学素子からの反射光の偏光状態を調整する波長板と、

該波長板で偏光状態を調整された平行光および電気光学素子からの反射光の偏光面を回転させるファラディ素子と、

該ファラディ素子と電気光学素子との間に設けられ、ファラディ素子からの平行光を電気光学素子に通過させるとともに、電気光学素子からの反射光からS波またはP波を分離して光の強度変化に変換する第2の検光子とを有することを特徴とする請求項5記載の電界検出光学装置。

【請求項8】 前記検光子または前記第1および第2の検光子は、偏光ビームスプリッタであることを特徴とする請求項1乃至4または請求項7のいずれか1つに記載の電界検出光学装置。

【請求項9】 前記電気光学素子の対向しない2つの側面は、前記平行光の進行方向に対して斜め加工を施されて形成された傾斜部を有することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1つに記載の電界検出光学装置。

【請求項10】 前記電気光学素子は、前記平行光の進行方向に対して直角方向の電界またはほぼ直角方向の電界に感応して光学特性が変化することを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1つに記載の電界検出光学装置。

【請求項11】 前記光源は、単一波長光を発生する発光ダイオードまたはレーザ光を発生するレーザ光源であることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1つに記載の電界検出光学装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばウェアラブルコンピュータ（身体につけるコンピュータ）間のデータ通信のために使用されるトランシーバにおいて送信情報に基づいて生体である電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を検出して電気信号に変換する電界検出光学装置に関する。

【0002】

【従来の技術】携帯端末の小型化および高性能化によりウェアラブルコンピュータが注目されてきているが、図7はこのようなウェアラブルコンピュータを人間に装着して使用する場合の例を示している。同図に示すように、ウェアラブルコンピュータ1はそれぞれトランシーバ3を介して人間の腕、肩、胴体などに装着されて互いにデータの送受信を行うとともに、更に手足の先端に取り付けられたトランシーバ3a、3bを介して外部に設けられたパソコン（PC）5とケーブルを介して通信を行うようになっている。

【0003】このようなウェアラブルコンピュータの実用化のためには、ウェアラブルコンピュータ間のデータ通信方式が非常に重要であるが、従来、このようなウェアラブルコンピュータ間のデータ通信は、上述したようにウェアラブルコンピュータ1に接続されたトランシーバ間をデータ線とグラウンド線の2本の電線で接続して有

線通信で行う方法、トランシーバ間を無線で接続して無線通信で行う方法、および生体を信号線とし、生体が接触している大地グラウンドをグラウンド線として利用した2線でデータの送受信を行う方法（PAN: Personal Area Network, IBMSYSTEMS JOURNAL, Vol.35, NOS.3&4, pp.609-617, 1996参照）などがある。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】上述した従来技術のうち、有線通信方法は、トランシーバ間を2線の電線で接続する必要があるため、離れたウェアラブルコンピュータ間や複数のウェアラブルコンピュータ間でデータの送受信を行う場合には、電線を体中に引き回さなければならず、実用的でないという問題がある。

【0005】また、無線通信方法は、無線周波数とパワーによっては近くに存在する他のシステムと混信する恐れがあるという問題がある。

【0006】更に、生体を信号経路として利用する通信方法は、一般的にウェアラブルコンピュータを上半身に取り付けるものが多いと考えられるが、例えばウェアラブルコンピュータのトランシーバを大地グラウンドから離れた頭部などに配置した場合には、通信が不可能になり、実用上大きな問題がある。

【0007】本発明は、上記に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、電線を必要とせず、無線でもなく、また大地グラウンドにも基本的には依存せずにウェアラブルコンピュータ用のトランシーバに使用され、電界を用いてデータ通信を適確に行うために使用される電界検出光学装置を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、請求項1記載の本発明は、電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を検出して電気信号に変換する電界検出光学装置であって、単一波長の光を発生する光源と、この光源からの光を平行光にするコリメートレンズと、該コリメートレンズからの前記平行光を入射され、かつ結合される電界に感応して光学特性が変化する電気光学素子と、前記電界伝達媒体に誘起された電界を前記電気光学素子に結合させるための第1の電極と、前記電気光学素子を通過した前記平行光をP波とS波に分離し、かつ光の強度変化に変換する検光子と、該検光子で分離されたP波およびS波のうち少なくとも一方を電気信号に変換する第1の光電気変換手段とを有し、前記第1の電極は、前記電気光学素子内を進行する前記平行光を挟むように位置する前記電気光学素子の対向する側面の一方に配置されることを要旨とする。

【0009】請求項1記載の本発明にあつては、電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を第1の電極を介して電気光学素子に結合させ、この電気光学素子に対して平行光を入射させ、この電気光学素子から出射した平行光を検光子でP波とS波に分離して光の強度変化に

変換し、P波およびS波のうち少なくとも一方を電気信号に変換して出力するので、例えばウェアラブルコンピュータ用のトランシーバに適用することにより、従来のように電線を使用しない通信、無線による他システムと混信のない通信、大地グランドに依存しない通信をウェアラブルコンピュータ間で適確に行うことができる。

【0010】また、請求項2記載の本発明は、電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を検出して電気信号に変換する電界検出光学装置であって、単一波長の光を発生する光源と、この光源からの光を平行光にするコリメートレンズと、該コリメートレンズからの前記平行光を入射され、多重反射させて出射すると共に、結合される電界に感応して光学特性が変化する電気光学素子と、前記電界伝達媒体に誘起された電界を前記電気光学素子に結合させるための第1の電極と、前記電気光学素子より出射した前記平行光をP波とS波に分離しかつ光の強度変化に変換する検光子と、該検光子で分離されたP波およびS波のうち少なくとも一方を電気信号に変換する第1の光電気変換手段とを有し、前記第1の電極は、前記電気光学素子内で多重反射している前記平行光を挟むように位置する前記電気光学素子の対向する側面の一方に配置されることを要旨とする。

【0011】請求項2記載の本発明にあっては、電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を第1の電極を介して電気光学素子に結合させ、この電気光学素子に対して平行光を入射して多重反射を行い、この電気光学素子から出射した平行光を検光子でP波とS波に分離して光の強度変化に変換し、P波およびS波のうち少なくとも一方を電気信号に変換して出力するので、例えばウェアラブルコンピュータ用のトランシーバに適用することにより、従来のように電線を使用しない通信、無線による他システムと混信のない通信、大地グランドに依存しない通信をウェアラブルコンピュータ間で適確に行うことができるとともに、また平行光を電気光学素子内で多重反射させているため、電界の影響を受ける光路長が長くなり、レーザ光は多くの偏光変化を受け、大きな信号を得ることができ、電気光学素子を小型にしても十分な感度を得られ、装置の小型化と低コスト化が可能となる。

【0012】更に、請求項3記載の本発明は、請求項1または2記載の本発明において、前記コリメートレンズと前記電気光学素子との間に設けられ、コリメートレンズからの平行光の偏光状態を調整して電気光学素子に入射する第1の波長板、前記電気光学素子の前記対向する側面の他方に設けられ、前記第1の電極に対してグランド電極として機能する第2の電極、前記電気光学素子と前記検光子との間に設けられ、電気光学素子を通過した平行光の偏光状態を調整して検光子に入射する第2の波長板、および前記検光子で分離されたP波およびS波のうちの他方を電気信号に変換する第2の光電気変換素子

のうちの少なくとも1つ以上を更に有することを要旨とする。

【0013】請求項4記載の本発明は、請求項2記載の発明において、前記平行光の入射方向において対向する電気光学素子の両側面に設けられ、平行光を電気光学素子内で多重反射させるための第1および第2の反射膜を更に有することを要旨とする。

【0014】また、請求項5記載の本発明は、電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を検出して電気信号に変換する電界検出光学装置であって、単一波長の光を発生する光源と、この光源からの光を平行光にするコリメートレンズと、該コリメートレンズから前記平行光を入射され、かつ結合される電界に感応して光学特性が変化する電気光学素子と、該電気光学素子の前記平行光の入射する端面に対向する他方の端面に設けられ、前記平行光を反射する反射膜と、前記電界伝達媒体に誘起された電界を前記電気光学素子に結合させるための第1の電極と、前記コリメートレンズと電気光学素子との間に設けられ、コリメートレンズからの平行光を通過させて電気光学素子に入射させ、前記反射膜で反射され、電気光学素子から入射方向に出射する前記平行光をP波とS波に分離し、光の強度変化に変換するアイソレータと、該アイソレータで分離されたP波およびS波のうち少なくとも一方を電気信号に変換する第1の光電気変換手段とを有し、前記第1の電極は、前記電気光学素子内を進行する前記平行光を挟むように位置する前記電気光学素子の対向する側面の一方に配置されることを要旨とする。

【0015】請求項5記載の本発明にあっては、電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を第1の電極を介して電気光学素子に結合させ、この電気光学素子に対して平行光を入射し反射膜で反射して出射させ、この電気光学素子から出射した平行光をアイソレータでP波とS波に分離して光の強度変化に変換し、P波およびS波のうち少なくとも一方を電気信号に変換して出力するので、例えばウェアラブルコンピュータ用のトランシーバに適用することにより、従来のように電線を使用しない通信、無線による他システムと混信のない通信、大地グランドに依存しない通信をウェアラブルコンピュータ間で適確に行うことができるとともに、また平行光を電気光学素子内で反射させているため、電界の影響を受ける光路長が長くなり、レーザ光は多くの偏光変化を受け、大きな信号を得ることができ、電気光学素子を小型にしても十分な感度を得られ、装置の小型化と低コスト化が可能となる。

【0016】更に、請求項6記載の本発明は、請求項5記載の発明において、前記電気光学素子の前記対向する側面の他方に設けられ、前記第1の電極に対してグランド電極として機能する第2の電極、前記アイソレータで分離されたP波およびS波のうちの他方を電気信号に変

換する第2の電気光学素子、および前記アイソレータと電気光学素子との間に設けられ、平行光の偏光状態を調整する波長板のうち少なくとも1つ以上を更に有することを要旨とする。

【0017】請求項7記載の本発明は、請求項5記載の発明において、前記アイソレータは、前記コリメートレンズからの平行光を通過させるとともに、電気光学素子からの反射光からP波またはS波を分離して光の強度変化に変換する第1の検光子と、該第1の検光子を通過したコリメートレンズからの平行光および電気光学素子からの反射光の偏光状態を調整する波長板と、該波長板で偏光状態を調整された平行光および電気光学素子からの反射光の偏光面を回転させるファラディ素子と、該ファラディ素子と電気光学素子との間に設けられ、ファラディ素子からの平行光を電気光学素子に通過させるとともに、電気光学素子からの反射光からS波またはP波を分離して光の強度変化に変換する第2の検光子とを有することを要旨とする。

【0018】請求項8記載の本発明は、請求項1乃至4または請求項7のいずれか1つに記載の本発明において、前記検光子または前記第1および第2の検光子が、偏光ビームスプリッタであることを要旨とする。

【0019】更に、請求項9記載の本発明は、請求項1乃至8のいずれか1つに記載の発明において、前記電気光学素子の対向しない2つの側面は、前記平行光の進行方向に対して斜め加工を施されて形成された傾斜部を有することを要旨とする。

【0020】請求項10記載の本発明は、請求項1乃至9のいずれか1つに記載の本発明において、前記電気光学素子が、前記平行光の進行方向に対して直角方向の電界またはほぼ直角方向の電界に感応して光学特性が変化することを要旨とする。

【0021】また、請求項11記載の本発明は、請求項1乃至10のいずれか1つに記載の発明において、前記光源が、単一波長光を発生する発光ダイオードまたはレーザー光を発生するレーザー光源であることを要旨とする。

【0022】

【発明の実施の形態】以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。図1は、本発明の第1の実施形態に係る電界検出光学装置の構成を示す図である。同図に示す電界検出光学装置11は、図6に示すようにウェアラブルコンピュータ1を電界伝達媒体である生体100に装着して、他のウェアラブルコンピュータやデータ通信装置とデータ通信を可能とするために使用されるトランシーバ3における電界検出光学部110として使用されるものである。

【0023】具体的には、図6に示すトランシーバ3は、ウェアラブルコンピュータ1から入力される送信データに基づく電界を生体100に誘起し、この誘起した電界を用いてデータの送受信を行うものであり、ウェア

ラブルコンピュータ1からの送信データを入出力（I/O）回路101を介して受け取ると、この送信データを送信回路103を介して送信電極105に供給し、該送信電極105を介して生体100に電界を誘起させ、この電界を生体100を介して生体100の他の部位に伝達させるものである。

【0024】また、図6に示すトランシーバ3は、生体100の他の部位に装着された別のトランシーバから生体100に誘起させられて伝達されてくる電界を受信電極107で検出し、この電界を電界検出光学部110に結合して電気信号に変換する。この電気信号は、信号処理回路109で増幅、雑音除去、波形整形などの信号処理を施され、入出力回路101を介してウェアラブルコンピュータ1に出力されるようになっている。

【0025】上述したトランシーバ3においては、図1に示す本発明の第1の実施形態の電界検出光学装置11から構成される電界検出光学部110は、生体100に誘起されて伝達され、受信電極107を介して結合される電界を検出し、電気信号に変換して信号処理回路109に出力するように機能するものである。

【0026】この電界検出光学部110を有するトランシーバ3を用いて、図7に示すように生体にウェアラブルコンピュータ1を取り付けた場合には、トランシーバ3はウェアラブルコンピュータ1からの送信情報に基づいて生体に電界を誘起し、図7で矢印付き波線で示すように相手のトランシーバ3に伝達し、これにより各ウェアラブルコンピュータ1はトランシーバ3を介してデータ通信を行なうようになっている。また、図7において手先や足先に設けられたトランシーバ3a、3bは、他のトランシーバ3を介してウェアラブルコンピュータ1から伝達されてくる電界を検出すると、この電界を電気信号に変換し、ケーブルを介してパソコン（PC）5に送信し、またパソコン5からケーブルを介して受信した送信情報を電界として生体に誘起して他のトランシーバ3に伝達するようになっている。

【0027】次に、図1を参照して、図6のトランシーバ3に使用される電界検出光学部110を構成する第1の実施形態の電界検出光学装置11について詳細に説明する。

【0028】図1に示す電界検出光学装置11は、レーザー光と電気光学結晶を用いた電気光学的手法により電界を検出するものであり、レーザー光源を構成するレーザーダイオード21および電気光学結晶からなる電気光学素子23を有する。なお、本実施形態の電気光学素子23は、レーザーダイオード21からのレーザー光の進行方向に対して直角方向に結合される電界にのみ感度を有し、この電界強度によって光学特性、すなわち複屈折率が変化し、この複屈折率の変化によりレーザー光の偏光が変化するようにになっている。なお、本実施形態では、レーザーダイオード21から出力されるレーザー光を用いているが、

本発明はレーザ光に限られるものでなく、単一波長光を発生するものであればよく、例えば発光ダイオード(LED)でもよいものであり、このことは後述する他の実施形態のすべてに適用し得ることである。

【0029】また、電気光学素子23は、例えば角柱の形状を有することが好ましくも、角柱に限定されるものでなく、他の形状、例えば円柱などでもよいものである。

【0030】電気光学素子23の図上で上下方向に対向する両側面には第1および第2の電極25、27が設けられている。なお、この第1および第2の電極25、27は、後述するようにレーザダイオード21からのレーザ光の電気光学素子23内における進行方向を両側から挟み、レーザ光に対して電界を直角に結合させるように構成されているものである。

【0031】電界検出光学装置11は、図6に示した受信電極107を構成する信号電極29を有し、この信号電極29は前記第1の電極25に接続されている。また、第1の電極25に対向する第2の電極27は、グラウンド電極31に接続され、第1の電極25に対してグラウンド電極として機能するように構成されている。なお、グラウンド電極31は、例えばトランシーバ3の電池に接続されたり、または大きめの金属などに接続することによりグラウンドとして機能し、第1の電極25から電気光学素子23への電界の結合を良好にすることができるものであるが、グラウンド電極31は必ずしも必要なものではない。このことは後述する他の実施形態のすべてに適用し得ることである。

【0032】信号電極29は、図6に示す受信電極107を構成するものであるが、生体100に誘起されて伝達されてくる電界を検出すると、この電界を第1の電極25に伝達し、第1の電極25を介して電気光学素子23に結合するようになっている。

【0033】レーザダイオード21から出力されるレーザ光は、コリメートレンズ33を介して平行光にされ、平行光となったレーザ光は第1の波長板35で偏光状態を調整されて電気光学素子23に入射するようになっている。電気光学素子23に入射されたレーザ光は、電気光学素子23内で第1、第2の電極25、27の間を伝播するが、このレーザ光の伝播中において上述したように信号電極29が生体100に誘起されて伝達されてくる電界を検出し、この電界を第1の電極25を介して電気光学素子23に結合したとすると、この電界は第1の電極25からグラウンド電極31に接続されている第2の電極27に向かって形成されて、レーザダイオード21から電気光学素子23に入射したレーザ光の進行方向に直角であるため、上述したように電気光学素子23の光学特性である複屈折率が変化し、これによりレーザ光の偏光が変化する。

【0034】このように電気光学素子23において第1

の電極25からの電界によって偏光が変化したレーザ光は、第2の波長板37で偏光状態を調整されて偏光ビームスプリッタ39に入射する。偏光ビームスプリッタ39は、検光子を構成するものであり、偏光子またはポラライザとも称するが、第2の波長板37から入射されたレーザ光をP波およびS波に分離して、光の強度変化に変換する。この偏光ビームスプリッタ39でP波成分およびS波成分に分離されたレーザ光は、それぞれ第1、第2の集光レンズ41a、41bで集光されてから、光電気変換手段を構成する第1、第2のフォトダイオード43a、43bに供給され、第1、第2のフォトダイオード43a、43bにおいてP波光信号とS波光信号をそれぞれの電気信号に変換して出力するようになっている。なお、上記実施形態では、偏光ビームスプリッタ39で分離されたP波成分およびS波成分は、それぞれ第1、第2のフォトダイオード43a、43bで両方とも電気信号に変換されて出力されるようになっているが、第1、第2のフォトダイオード43a、43bおよび第1、第2の集光レンズ41a、41bはいずれか一方のみを設け、P波成分、S波成分のうち的一方のみを電気信号に変換して出力してもよいものである。このことは後述する他の実施形態のすべてに適用し得ることである。

【0035】上述したように第1、第2のフォトダイオード43a、43bから出力される電気信号は、図6に示す信号処理回路109で増幅、雑音除去、波形整形などの信号処理を施されてから、入出力回路101を介してウェアラブルコンピュータ1に供給されることとなる。

【0036】次に、図2を参照して、本発明の第2の実施形態に係る電界検出光学装置について説明する。

【0037】図2に示す電界検出光学装置12は、図1に示した電界検出光学装置11において電気光学素子23の対向しない2つの側面23aおよび23bをレーザ光の進行方向に対して斜め加工して傾斜部を形成した点が異なるのみであり、その他の構成および作用は同じである。

【0038】電気光学素子23は、電界が加わると、電気光学素子23を構成する結晶が物理的に歪むという逆圧電効果という現象が発生する。この逆圧電効果による歪みによりレーザ光の偏光は変化するが、この変化は通常少ない。ところが、電界がある周波数で変化すると、電気光学素子23の物理的な歪みも周波数とともに変化し、この変化が結晶の対向面の距離と共振したとき、大きな効果が発生し、偏光変化が極めて大きくなる。このような共振が発生すると、波形が歪み、通信エラーとなる。

【0039】従って、図2に示した第2の実施形態の電界検出光学装置12は、このような逆圧電効果による共振を防止するために、電気光学素子23の対向しない2

つの側面 23a, 23b を斜めに加工し、これにより共振しないように構成しているものである。なお、レーザー光の進行方向に対する斜め角度は、 $0.5^\circ \sim 1.0^\circ$ が好ましい。このように電気光学素子 23 の側面 23a, 23b を斜め加工して共振を防止することにより、周波数特性を平坦にすることができ、波形が歪んで通信エラーが発生することを適確に防止し得るものである。

【0040】次に、図 3 を参照して、本発明の第 3 の実施形態に係る電界検出光学装置について説明する。

【0041】図 3 に示す第 3 の実施形態の電界検出光学装置 13 は、図 1 に示した第 1 の実施形態の電界検出光学装置 11 と同様にレーザーダイオード 21 および電気光学素子 23 を有し、電気光学的手法により電界を検出する点は同じであるが、図 1 の電界検出光学装置 11 ではレーザー光が電気光学素子 23 を透過するタイプのものであったのに対して、図 3 の電界検出光学装置 13 はレーザーダイオード 21 からのレーザー光が入射する電気光学素子 23 の端面と反対側の端面に反射膜 51 を設け、これにより電気光学素子 23 内に進んだレーザー光が反射膜 51 で反射され、入射端面から出射する反射タイプの電界検出光学装置である点が図 1 の電界検出光学装置 11 と異なる。

【0042】すなわち、図 3 に示す第 3 の実施形態の電界検出光学装置 13 は、レーザーダイオード 21 からのレーザー光を平行光にするコリメートレンズ 33、電気光学素子 23 の対向する両側面に設けられた第 1、第 2 の電極 25、27、この第 1、第 2 の電極 25、27 に接続された信号電極 29 およびグランド電極 31、レーザー光の P 波成分および S 波成分を集光する第 1、第 2 の集光レンズ 41a, 41b、および第 1、第 2 の集光レンズ 41a, 41b で集光された P 波光信号および S 波光信号をそれぞれ電気信号に変換する第 1、第 2 のフォトダイオード 43a, 43b を有する点については図 1 に示す電界検出光学装置 11 と同じである。

【0043】これらの構成要素に加えて、図 3 に示す電界検出光学装置 13 は、コリメートレンズ 33 と電気光学素子 23 との間に設けられ、コリメートレンズ 33 から入射したレーザー光を電気光学素子 23 に向けて通過させ、電気光学素子 23 の反射膜 51 から反射されて戻ってくるレーザー光を P 波および S 波に分離し、光の強度変化に変換するアイソレータ 61 であって、第 1 の偏光ビームスプリッタ 53、 $\lambda/2$ 波長板からなる第 1 の波長板 55、ファラディ素子 57、第 2 の偏光ビームスプリッタ 59 からなるアイソレータ 61 と、レーザー光の偏光状態を調整する第 2 の波長板 63 とを更に有する。

【0044】アイソレータ 61 を構成する第 1 の偏光ビームスプリッタ 53 は、コリメートレンズ 33 からのレーザー光を通過させるとともに、電気光学素子 23 からの反射光から P 波または S 波を分離して光の強度変化に変換して第 1 の集光レンズ 41a に入射し、 $\lambda/2$ 波長板

を構成する第 1 の波長板 55 は第 1 の偏光ビームスプリッタ 53 を通過したコリメートレンズ 33 からのレーザー光および電気光学素子 23 からの反射光の偏光状態を調整し、ファラディ素子 57 は第 1 の波長板 55 で偏光状態を調整されたレーザー光および電気光学素子 23 からの反射光の偏光面を回転させ、第 2 の偏光ビームスプリッタ 59 はファラディ素子 57 からのレーザー光を電気光学素子 23 に通過させるとともに、電気光学素子 23 からの反射光から S 波または P 波を分離して光の強度変化に変換して第 2 の集光レンズ 41b に入射させるようになって

いる。

【0045】更に詳しくは、アイソレータ 61 は、コリメートレンズ 33 からのレーザー光を通過させ、第 2 の波長板 63 でレーザー光の偏光状態を調整して電気光学素子 23 に入射させ、この入射したレーザー光が電気光学素子 23 内で第 1、第 2 の電極 25、27 間を伝播する場合には、信号電極 29 が生体 100 に誘起されて伝達されてくる電界を検出し、この電界が第 1 の電極 25 を介して電気光学素子 23 に結合されたとなると、この電界は第 1 の電極 25 からグランド電極 31 に接続されている第 2 の電極 27 に向かって形成されて、レーザーダイオード 21 から電気光学素子 23 に入射したレーザー光の進行方向に直角であるため、電気光学素子 23 の光学特性である複屈折率に変化し、これによりレーザー光の偏光が変化するが、このように電界によって光学特性の変化した電気光学素子 23 内を通過して偏光状態の変化したレーザー光が反射膜 51 に至り、反射膜 51 で反射され、電気光学素子 23 内を反対方向に戻る場合にも同様に偏光状態が変化して電気光学素子 23 から出射するレーザー光は、アイソレータ 61 に入射し、アイソレータ 61 の第 1、第 2 の偏光ビームスプリッタ 53、59 で P 波と S 波に分離され、光の強度変化に変換されて出射するようになっている。

【0046】このようにアイソレータ 61 の第 1、第 2 の偏光ビームスプリッタ 53、59 からそれぞれ出射する P 波成分および S 波成分のレーザー光は、第 1、第 2 の集光レンズ 41a, 41b で集光されて第 1、第 2 のフォトダイオード 43a, 43b に入射し、電気信号に変換されて出力されるようになっている。

【0047】本実施形態では、レーザー光は反射膜 51 で反射されて電気光学素子 23 内を往復して電界の影響を受ける光路長が長くなり、レーザー光は多くの偏光変化を受け、大きな信号を得ることができる。従って、電気光学素子を小型にしても十分な感度を得られるので、装置の小型化と低コスト化が可能となる。

【0048】次に、図 4 を参照して、本発明の第 4 の実施形態に係る電界検出光学装置について説明する。

【0049】図 4 に示す電界検出光学装置 14 は、図 1 の実施形態に対する図 2 の実施形態と同様に、図 3 に示した電界検出光学装置 13 において電気光学素子 23 の

対向しない2つの側面をレーザー光の進行方向に対して斜め加工して傾斜部を形成し、これにより電気光学素子23の逆圧電効果による共振を防止して、周波数特性を平坦にし、波形が歪んで通信エラーが発生することを防止するようにした点が異なるのみであり、その他の構成および作用は同じである。なお、図4では、電気光学素子23の上側面が斜め加工されている部分のみが示されているが、この上側面に隣接する対向しない側面も斜め加工されているものである。

【0050】次に、図5を参照して、本発明の第5の実施形態に係る電界検出光学装置について説明する。

【0051】図5に示す第5の実施形態の電界検出光学装置15は、図1に示した第1の実施形態の電界検出光学装置11と同様にレーザーダイオード21および電気光学素子23を有し、電気光学的手法により電界を検出する点は同じであるが、図1の電界検出光学装置11ではレーザー光が電気光学素子23をまっすぐに透過するタイプのものではあったのに対して、図5に示す電界検出光学装置15は、レーザー光が電気光学素子23内で多重反射を行いながら透過する多重反射透過タイプの電界検出光学装置である点が図1の電界検出光学装置11と異なる。なお、電気光学素子23はレーザー光の進行方向と直角の電界に感度を有し、結合した電界強度によって光学特性が変化することは基本的に同じであるが、レーザー光の進行方向と電界の方向は正確に直角である必要はなく、図5に示すようにほぼ直角であればよく、すなわち若干直角からずれていてもよいものである。

【0052】このようにレーザー光を電気光学素子23内で多重反射させるとともに、この多重反射するレーザー光の進行方向に対して電界をほぼ直角に結合させるために、図5の電界検出光学装置15は、第1、第2の電極25、27が設けられている電気光学素子23の対向する側面の対向方向に対して直角な方向において対向する別の側面に第1、第2の反射膜71、73が設けられ、この第1、第2の反射膜71、73間においてレーザー光が多重反射するように構成されている。なお、その他の構成は基本的には図1の実施形態と同じである。

【0053】そして、レーザーダイオード21からのレーザー光は、コリメートレンズ33で平行光にされてから、第1の波長板35で偏光状態を調整され、第2の反射膜73と第1の電極25との間から第1、第2の電極25、27間の電界にほぼ直角であるように第1の反射膜71に向けて電気光学素子23に入射され、第1の反射膜71で同様に電界にほぼ直角な方向に反射され、この反射レーザー光は更に第2の反射膜73で電界にほぼ直角な方向に反射されるという動作を図示のように繰り返して多重反射し、最後は第2の反射膜73と第2の電極27との間から外部に射出する。

【0054】このようにレーザー光が電気光学素子23内で多重反射する間に、信号電極29が生体100に誘起

されて伝達されてくる電界を検出し、この電界を第1の電極25を介して電気光学素子23に結合したとすると、この電界は第1の電極25からグラウンド電極31に接続されている第2の電極27に向かって形成されて、レーザーダイオード21から電気光学素子23に入射して多重反射するレーザー光の進行方向である多重反射方向に直角であるため、電気光学素子23の光学特性である複屈折率が変化し、これにより多重反射するレーザー光の偏光が変化する。

【0055】このように多重反射しながら偏光状態が変化した電気光学素子23から射出したレーザー光は、第2の波長板37で偏光状態を調整されて偏光ビームスプリッタ39に入射する。偏光ビームスプリッタ39は第2の波長板37から入射されたレーザー光をP波およびS波に分離して、光の強度変化に変換する。このP波成分およびS波成分に分離されたレーザー光は、それぞれ第1、第2の集光レンズ41a、41bで集光されてから、第1、第2のフォトダイオード43a、43bに供給され、第1、第2のフォトダイオード43a、43bにおいてP波光信号とS波光信号をそれぞれの電気信号に変換して出力するようになっている。

【0056】本実施形態では、レーザー光は電気光学素子23内で多重反射して電界の影響を受ける光路長が長くなっていて、レーザー光は多くの偏光変化を受けるため、大きな信号を得ることができる。従って、電気光学素子を小型にしても十分な感度が得られるので、装置の小型化と低コスト化が可能となる。

【0057】また、図5に示した実施形態の電界検出光学装置15に対しては、上述した図2、図4の実施形態と同様に、電気光学素子23の対向しない2つの側面をレーザー光の進行方向に対して斜め加工して傾斜部を形成し、これにより電気光学素子23の逆圧電効果による共振を防止して、周波数特性を平坦にし、波形が歪んで通信エラーが発生することを防止するように構成することも可能である。

【0058】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を第1の電極を介して電気光学素子に結合させ、この電気光学素子に対して平行光を入射させ、検光子でP波とS波に分離して光の強度変化に変換し、P波およびS波のうち少なくとも一方を電気信号に変換して出力するので、例えばウェアラブルコンピュータ用のトランシーバに適用することにより、従来のように電線を使用しない通信、無線による他システムと混信のない通信、大地グラウンドに依存しない通信をウェアラブルコンピュータ間で適確に行うようにすることができる。

【0059】また、本発明によれば、電界伝達媒体に誘起されて伝達されてくる電界を第1の電極を介して電気光学素子に結合させ、この電気光学素子に対して平行光

を入射して反射または多重反射を行い、この電気光学素子から出射した平行光をP波とS波に分離して光の強度変化に変換し、P波およびS波のうち少なくとも一方を電気信号に変換して出力するので、例えばウェアラブルコンピュータ用のトランシーバに適用することにより、従来のように電線を使用しない通信、無線による他システムと混信のない通信、大地グラウンドに依存しない通信をウェアラブルコンピュータ間で適確に行うようにすることができるとともに、また平行光を電気光学素子内で反射または多重反射させているため、電界の影響を受ける光路長が長くなり、レーザ光は多くの偏光変化を受け、大きな信号を得ることができ、電気光学素子を小型にしても十分な感度が得られ、装置の小型化と低コスト化が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る電界検出光学装置の構成を示す図である。

【図2】本発明の第2の実施形態に係る電界検出光学装置の構成を示す図である。

【図3】本発明の第3の実施形態に係る電界検出光学装置の構成を示す図である。

【図4】本発明の第4の実施形態に係る電界検出光学装置の構成を示す図である。

【図5】本発明の第5の実施形態に係る電界検出光学装置の構成を示す図である。

【図6】ウェアラブルコンピュータを生体に取り付けるためのトランシーバであって、本発明の電界検出光学装置が適用されるトランシーバの回路構成を示すブロック

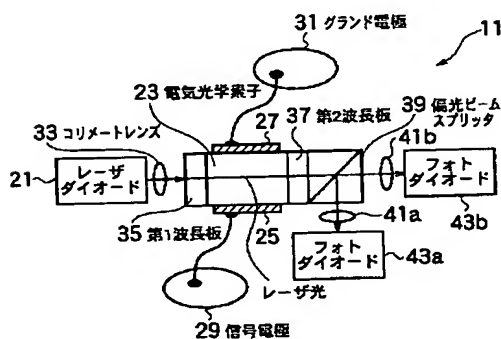
図である。

【図7】トランシーバを介してウェアラブルコンピュータを人間に装着して使用する場合の例を示す説明図である。

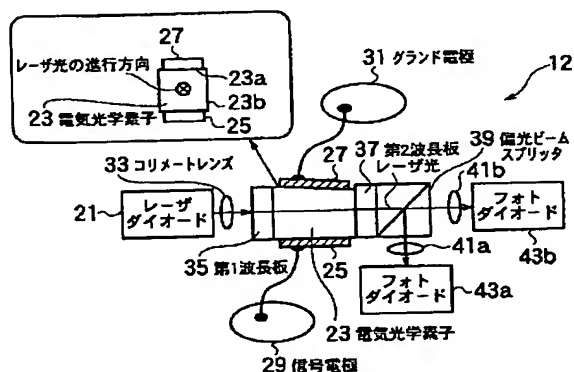
【符号の説明】

- 1 ウェアラブルコンピュータ
- 3 トランシーバ
- 11, 12, 13, 14, 15 電界検出光学装置
- 21 レーザダイオード
- 23 電気光学素子
- 25, 27 第1、第2の電極
- 29 信号電極
- 31 グラウンド電極
- 33 コリメートレンズ
- 35 第1の波長板
- 37 第2の波長板
- 39 偏光ビームスプリッタ
- 41a, 41b 第1、第2の集光レンズ
- 43a, 43b 第1、第2のフォトダイオード
- 51 反射膜
- 53 第1の偏光ビームスプリッタ
- 55 第1の波長板 ($\lambda/2$ 波長板)
- 57 ファラディ素子
- 59 第2の偏光ビームスプリッタ
- 61 アイソレータ
- 71, 73 第1、第2の反射膜
- 100 生体
- 110 電界検出光学部

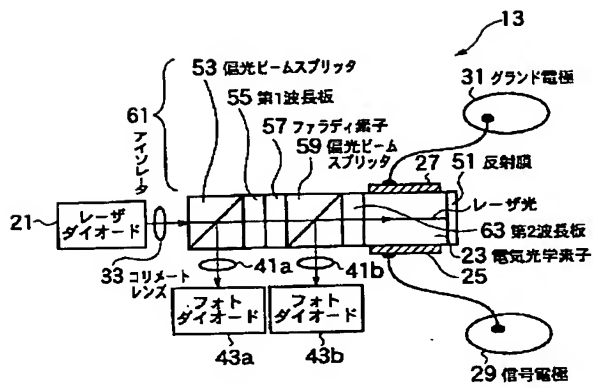
【図1】



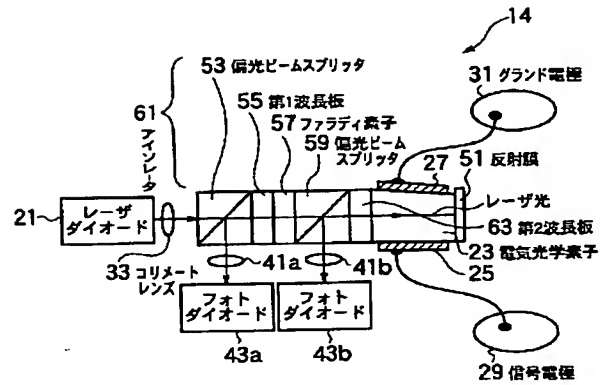
【図2】



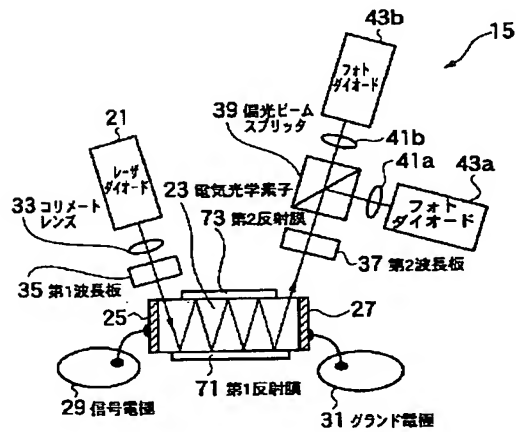
【図3】



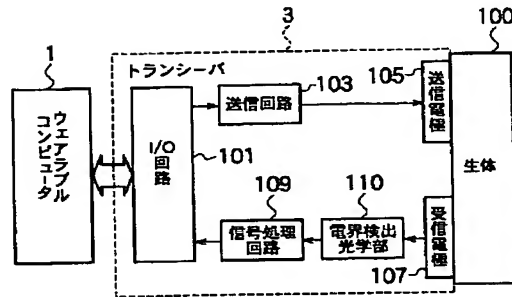
【図4】



【図5】



【図6】



【図7】

